

最先端プラズマプロセス:未来への挑戦 一産官学連携による新たなイノベーションー

主催: 東北大学流体科学研究所未だエネルギー研究センター

日時: 2018年1月26日(金)–1月27日(土)

場所: 東北大学流体科学研究所2号館5階大講義室

1月26日(金)

【講演時間 45 分】

13:00–13:45 遠藤和彦(産業技術総合研究所)「最先端ナノデバイスの現状と今後の展開」

13:45–14:30 寒川誠二(東北大学)「ナノデバイスにおける原子層プラズマプロセスの挑戦」

<休憩> 14:30–14:50 (20 分)

【講演時間 30 分】

14:50–15:20 岩下伸也(東京エレクトロン)「PEALD–TiO₂薄膜作製プロセスの開発」

15:20–15:50 北嶋武(防衛大学校)「表面–ナノ粒子–プラズマ界面相互作用」

15:50–16:20 笠嶋悠司(産業技術総合研究所)「半導体量産装置用プラズマプロセスモニタリング手法の開発」

16:20–16:50 白谷正治(九州大学)「プラズマプロセスの新潮流」

1月27日(土)

【講演時間 45 分】

09:30–10:15 野沢俊久(日本ASM)「半導体製造工程における PEALD技術」

【講演時間 30 分】

10:15–10:45 加藤俊顕(東北大学)「Atomic Engineering of Nanocarbon Materials with Nanoscale Plasma Processing(仮)」

<休憩> 10:45–11:00 (15 分)

11:00–11:30 布村正太(産業技術総合研究所)「先端プラズマプロセス下における半導体物性のその場評価」

11:30–12:00 鈴木陽香(名古屋大学)「大面積かつ高速表面処理のための大気圧プラズマ装置開発」